

# LIST of ABBREVIATIONS

by K. Ishikawa

## INDEX

<u>Capital</u>	<u>Page</u>	<u>Capital</u>	<u>Page</u>
A	2	N	24
B	4	O	25
C	5	P	26
D	8	Q	29
E	10	R	30
F	12	S	31
G	14	T	35
H	15	U	38
I	16	V	39
J, K	18	W	40
L	19	X, Y, Z	41
M	21		

PDF文書のトップ画面で、「しおり」タブをクリックしてしおりを表示して、希望のページをクリックしてジャンプしてください

[トップページへ](#)

\* A

AAS	Atomic Absorption Spectroscopy (原子吸光分析)
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene
ABS	Anti-lock Braking System (アンチロックブレーキシステム)
ABWR	Advanced Boiled Water Reactor (新型沸騰水型軽水炉)
AC	Alternating Current (交流 直流)
ACC	Automatic Chroma Control
ACF	Anisotropic Conductive Film (異方性導電フィルム)
ACP	Advanced Communication Processor (次世代通信用プロセッサ)
ACP	Anisotropic Conductive Paste (異方性導電ペースト)
ACT	Automatic Channel Control & Timer
AD	Anno Domini (紀元後)
AD	Automatic Depository (自動貯金機)
ADC	Analog to Digital Converter (アナログ・デジタル変換器)
ADC	Automatic Diameter Control (自動直径制御)
ADD	Acid Droplet Decomposition (液滴分解法)
ADD	Automatic Defect Detector (自動欠陥検出器)
ADR	Address (アドレス)
ADS	Advanced Data Processing System (次世代データ処理システム)
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line (非対称デジタル加入者線電送方式)
AE	Acoustic Emission (非破壊検査)
AE	Administration Engineering
AES	Auger Electron Spectroscopy (オージェ電子分光分析)
AF	Auto Focus (自動焦点)
AFC	Automatic Flow Controller
AFC	Automatic Frequency Control (自動周波数制御)
AFM	Atomic Force Microscope (原子間力顕微鏡)
AFPC	Automatic Frequency & Phase Control (自動周波数・位相制御)
AGC	Automatic Gain Control (自動利得制御)
AGS	Automatic Generating System (時計の自動発電システム)
AGV	Automatic Guided Vehicle (自走型搬送車)
AHS	Advanced Cruise-assist Highway System (走行支援道路システム)
AI	Acceptance Inspection (受入検査)
AI	Artificial Intelligence (人工知能)
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome (後天性免疫不全症候群)
ALC	Automatic Level Control (自動レベル制御)
ALIVH	Any Layer Inner Via Hole (全層インナーバイアホール構造)
ALU	Arithmetic & Logic Unit (論理演算装置)
ALWR	Advanced Light Water Reactor (改良型軽水炉)
AM	Amplitude Modulation (電波の振幅変調)
AMAT	<u>A</u> pply <u>M</u> aterial Co. (アプライドマテリアル社)
AMF	Asian Monetary Fund (アジア通貨基金)

AMHS	Automated Material Handling System
AMI	American Microsystem Inc.
AMM	Advanced Manufacturing Method (次世代製造方法)
AOP	Anomalous Oxygen Precipitation (異常酸素析出)
AOV	Air Operated Valves
APC	Automatic Phase Control (自動位相制御)
APCT	Advanced Perfect Crystal Technology (次世代完全結晶技術)
APD	Avalanche Photo Diode (なだれ増倍型フォトダイオード)
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation (アジア太平洋経済協力会議)
APM	Ammonia Peroxide Mixture (アンモニア過酸化水素混合水溶液)
APS	Automatic Packaging System (自動包装システム)
APS	Automatic Positioning System (自動位置決めシステム)
AQL	Acceptable Quality Level (合格品質水準)
AR	Anti Reflection (光の反射防止)
ARL	Anti-Reflective Layer (反射防止層)
ART	<u>A</u> utomatic <u>R</u> outing
ASA	American Standard Association (米国規格協会・フィルムの感度表示)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (情報交換用米国標準コード)
ASET	<u>A</u> ssociation of <u>S</u> uper-advanced <u>E</u> lectronics <u>T</u> echnologies (技術研究組合超先端電子技術開発機構)
ASG	Alumino-Silicate Glass (アルミノ・ケイ酸ガラス)
ASIC	Application Specific IC (特定用途向けIC)
ASO	Area of Safe Operation (安全動作領域)
ASP	Application Service Provider (e-mail 配信プロバイダー)
ASS	Average Sample Size (平均サンプルサイズ)
ASSET	All Spacer Separated Element Transistor
ASSP	Application Specific Standard Product (特定用途向け専用標準製品)
AST	Advanced Super Speed Technology
ASTM	American Society for Testing & Materials (米国材料試験協会)
AT	Approval Test (認定試験)
ATC	Automatic Traffic Control (自動交通制御)
ATC	Automatic Temperature Control (自動温度制御)
ATLAS	<u>A</u> utomatic <u>T</u> ranslation <u>S</u> ystem (自動翻訳システム)
ATM	Asynchronous Transfer Mode (非同期転送モード)
ATOK	<u>A</u> dvanced <u>T</u> echnology <u>O</u> f <u>K</u> ana-Kanji Transfer
ATS	Approval Test System (認定試験システム)
ATS	Automatic Train Stop (自動列車停止装置)
AV	Audio-visual (視聴覚の)
AVR	Automatic Voltage Regulator (自動電圧安定装置)
AY	Assembly Yield (組立歩留)

\* B

BASIC	Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (コンピュータ用プログラム言語)
BB	Bread Board (IC試験時の回路特性チェック)
B/B	Book to Bill ratio (受注対出荷額比)
BBA	Bachelor of Business Administration (経営学士)
BBS	Bulletin Board System (電子掲示板システム)
BC	Before Christ (紀元前)
BCC	Body Centered Cubic
BCD	Binary Coded Decimal notation (2進化10進数)
BCS	Buried Convex waveguide Structure (活性層埋込み型半導体レーザー構造)
BCU	Bus Control Unit
BD	Button Diode (ボタン型ダイオード)
BDI	Base Diffusion Isolation (ベース拡散分離)
BDU	Bidirectional Driver Unit
BEF	Band Eliminate Filter
BEP	Break Even Point (損益分岐点)
BGA	Ball Grid Array (はんだボールを使った表面実装型多ピン外囲器)
Bi-MOS	Bipolar & MOS IC (バイポーラ・MOS型混載IC)
BIOS	Basic Input Output Systems (基本入出力システム)
BIP	<u>B</u> ipolar Device (バイポーラ素子)
BIT	<u>B</u> inary <u>D</u> igit (2進数の1桁)
BMD	Bulk Micro Defect (バルク微小欠陥)
BN	Boron Nitride (窒化ボロン)
BOD	Biochemical Oxygen Demand (生物化学的酸素要求量)
BOSS	Book of SEMI Standard (半導体の標準化に関するマニュアル)
BOX	Buried Oxide Isolation (埋入酸化膜による素子間分離)
BPA	<u>B</u> onding <u>P</u> ads on the <u>A</u> ctive Area (素子上ボンディング)
BPF	Band Pass Filter (帯域通過フィルター)
BPI	Bit Per Inch (1インチ当りの記録密度)
BPSG	Boro-Phospho-Silicate Glass (ボロンとリンを含んだ酸化膜)
BS	British Standard (英国工業規格)
BS	Broadcasting Satellite (放送衛星)
BSD	Back Side Damage (ウェーハの裏面損傷)
BSG	Boron-Silicate Glass (ボロンを含んだ酸化膜)
BSP	<u>B</u> ack <u>S</u> ide <u>P</u> oly-Silicon (ウェーハ裏面にポリシリコン付き)
BT	Bias & Temperature
BTC	Bias & Temperature Cycling (周期的BT)
B to B	Business to Business (企業間電子商取引)
B to C	Business to Consumer (企業消費者間電子商取引)
BU	Business Unit (業態単位)
BV	Book Value (帳簿価格、簿価)

\* C

CA	Chemically Amplified (化学増幅型)
CABS	Computer Aided Batch System
CABS	Computer Aided Batch Scheduling Program
CAD	Computer Aided Design(コンピュータ支援設計システム)
CAE	Computer Aided Engineering(コンピュータ支援工学)
CAGR	Compound Annual Growth Rate(年間平均成長率)
CALB	Computer Aided Line Balancing
CALDAS	Computer Aided Life Data Arrangement System
CALPIS	Computer Aided Lot Priority Information System
CALS	Commarce At Light Speed
CAM	Computer Aided Manufacturing(コンピュータを使った製造の自動化システム)
CAM	Content Addressable Memory
CAM	Cyclic Access Memory
CAMEL	Computer Aided Machine Loading(コンピュータ支援装置負荷)
CAR	Controlled Avalanche Rectifier
CARAM	Content Addressable RAM
CATS	Continuous Assembly & Test System(連続で組立・テストするシステム)
CATV	Cable Television(有線テレビジョン放送)
CB	Citizen Band(市民帯ラジオ)
CC	Carbon Copy(カーボンコピー、写し文書)
CC	Chip Carrier(チップキャリア、LSIの外囲器の一種)
CC	Commercial Cost(商用価格)
CCB	Controlled Collapse Bonding(はんだハンブ使用フェースダウンボンディング)
C <sup>3</sup>	Computer Controlled Clean room(コンピュータで管理されたクリーンルーム)
C <sup>3</sup> L	Complementary Constant Current Logic
C4	Controlled Collapse Chip Connection
CCCZ	Continuous Charging Czochralski (Method)
CCD	Charge Coupled Device(電荷結合素子)
C <sup>2</sup> MOS	Clocked Complementary MOS
CCRT	Color Cathode Ray Tube(カラー陰極線管、カラーブラウン管)
CCW	Counter Clockwise(反時計回り方向)
CD	Compact Disc(デジタル信号を記録する光ディスク)
CD	Cost Down(原価低減)
CD	Critical Dimension
CDE	Chemical Dry Etching(プラズマによる反応種を用いるエッチング)
CDI	Collector Diffusion Isolation(コレクタ拡散分離)
CDMA	Code Division Multiple Access(符号分割多元接続)
CDP	Carrier Development Program
CEL	Contrast Enhanced Lithography
CEO	Chief Exective Officer(最高経営責任者)
CEO	Cost of Equipment Ownership

CERDIP	<u>Ceramic DIP</u> (DIP型の低価格セラミックパッケージ)
CF	Cost & Freight (運賃込み値段)
CFC	ChloroFluoroCarbon (フロンガス)
CFL	Collector Function Logic (改良型ECL回路)
CG	Computer Graphics (図形や画像を作成・表示する技術)
CG	Crystal Growth (単結晶成長)
CHMSL	Center High Mount Stop Lamp (自動車の後部中央ブレーキランプ)
CI	Corporate Identity (企業認識)
CIF	Common Intermediate Format (共通中間フォーマット)
CIF	Cost, Insurance & Freight (運賃保険料込み値段)
CIM	Computer Integrated Manufacturing (コンピュータ統合生産システム)
CIP	Cold Isotropic Press (冷感プレス)
CISC	Complex Instruction Set Computer (複雑命令セットコンピュータ)
CL	Crucible Lifting Speed (ルツボ上昇速度)
CLK	Clock (クロック、時間)
CML	Current Mode Logic (電流モード論理回路)
CMOS	Complementary MOS (相補型MOS)
CMP	Chemical Mechanical Polishing (化学・機械研磨)
CMR	Common Mode Rejection
CMRR	Common Mode Rejection Ratio
CMT	Cassette Magnetic Tape (カセット磁気テープ)
CNC	Condensation Nucleus Counter
COB	Chip on Board (実装基板に直接アセンブリする技術)
COBOL	Common Business Oriented Language (事務処理用高級プログラミング言語)
COC	Cost Of Consumable (消耗品コスト)
COCOM	<u>Coordinating Committee for export control</u> (対共産圏輸出統制委員会)
COD	Chemical Oxygen Demand (化学的酸素要求量)
COG	Chip on Glass (液晶ドライバの実装方式)
COMFET	Conductivity Modulated FET (電導度変調FET)
COO	Cost of Ownership (設備のコストパフォーマンス)
COP	Crystal Originated Particle (結晶起因パーティクルまたはピット)
COSMOS	<u>Complementary Symmetry MOS</u>
CP	Chemical Polishing (エッチングによる化学的研磨)
CP	Compliance Program (企業が策定する法令遵守規定)
CP	Crucible Position (ルツボ位置)
CPI	Cycle per Instruction
CPM	Critical Path Method
CPT	Color Picture Tube (カラーブラウン管)
CPTV	Channel Programming TV
CPU	Central Processing Unit (中央演算処理装置)
CR	Card Reader (カード読取り機)
CR	Clean Room (クリーンルーム、空気の清浄度が制御された部屋)

CR	Crucible Rotation(ルツボ回転数)
CRAM	Complementary MOS RAM
CRE	Chemical Reactor Equipment
CRM	Customer Relationship Management(顧客情報管理システム)
CRT	Cathode Ray Tube(陰極線管、通称ブラウン管)
CS	Commercial Sample(商用見本)
CS	Communication Satellite(通信衛星)
CS	Customer Satisfaction(顧客満足度)
CSB	Common System Bus
CSD	Coated Source Deposition(不純物原塗布)
CSIA	China Semiconductor Industry Association(中国半導体工業協会)
CSM	Customer Satisfaction Management(顧客満足度管理)
CSP	Chip Size(or Scale) Package(チップ大の外囲器)
CSP	Compatible Standard Package
CSS	Check Sheet System
CST	Cost Schedule Technology
CT	Computed Tomography(コンピュータ処理X線断面撮影法)
CTI	Computer Telephony Integration(電話とコンピュータの融合システム)
CTR	<u>C</u> ontrol <u>R</u> egister
CU	Computing Unit
CU	Cost Up(価格上げ)
CV	Check Valve
C-V	Capacitance-Voltage
CVD	Chemical Vapor Deposition(化学反応をともなう気相成長)
CW	<u>C</u> lock <u>w</u> ise(時計回り方向)
CZ	<u>C</u> zochralski Method(単結晶の回転引上げ法)

* D	
DAC	Design for Assembly Cost-effectiveness
DAC	Digital to Analog Converter (デジタル信号からアナログ信号への変換器)
DAD	Digital Audio Disk
DAPS	Direct Access Programming System
DAT	Design Approval Test (設備機能確認試験)
DAT	Digital Audio Taperecorder (デジタルテープ録音装置)
DB	Data Base (データベース)
DBG	Dicing Befor Grinding (裏面グラインディングより先ダイシング)
DBS	Direct Broadcasting Satellite (直接放送衛星)
DC	Debit Card (即時決済カード)
DC	Direct Current (直流)
DCC	Digital Cassette Controller
DCC	Digital Compact Cassette (デジタル録音用カセット)
DCS	Diffusion Control System (拡散制御システム)
DCTL	Direct Coupled Transistor Logic (直結型トランジスタ論理回路)
DCU	Device Control Unit
DD	Design Data (設計データ)
DDA	Digital Differential Analyzer
DDC	Direct Digital Control
DDD	Double Diffused Drain (二重拡散ドレイン)
DEPO	Deposition
DEV	Device (装置)
DF	Dislocation Free (無転位)
DF	Document File (文書ファイル)
DFCL	Direct Coupled FET Logic
DI	Delivery Inspection
DIAC	Diode AC Switch (双方向性負性抵抗素子)
DIC	Discrete IC
DIMM	Dual Inline Memory Module (メモリ増設用モジュール)
DIN	Deutsches Institut fur Normung e.v. (ドイツ工業規格)
DINAMO	Dynamic Model
DIP	Dual Inline Package (リード挿入型IC標準外囲器)
DIPET	Dielectric Isolation Using Preferential Etching Technology
DK	Donor Killer (ドナーキラー)
DLL	Dynamic Link Library (Windows用のライブラリファイル)
DLTS	Deep Level Transient Spectroscopy
DM	Decimal Minute (60/100 sec)
DMA	Direct Memory Access (メモリとメモリ間の直接データ転送)
DMA	Dynamic Mechanical Analysis System (動的機械分析システム)
DMAC	Direct Memory Access Controller

DMG	Ductile Mode Grinding
DMOS	Double Diffusion MOS (チャンネルを二重拡散したMOS)
DN	Data-Net
DNA	<u>D</u> eoxyribo <u>n</u> ucleic <u>A</u> cid (デオキシリボ核酸 遺伝子の本体)
DNS	Domain Name System (電子メールアドレスシステム)
DOF	Depth of Focus (焦点深度)
DOPOS	<u>D</u> oped <u>P</u> oly- <u>S</u> ilicon (不純物を拡散したポリシリコン)
DOS	Disc Operating System (コンピュータの基本ソフトウェア)
DP	Dynamic Programming (音声認識でのマッチング方式)
DPB	Double Positive Bevel (二重正ベベル)
DRAM	Dynamic Random Access Memory (データの再書き込みが必要なメモリ)
DRM	Dipole Ring Magnet
DS	Design Sample (設計サンプル)
D/S-Y	Die Sorter Yield
DSA	Diffused Self Alignment (拡散自己整合)
DSB	Double Side Band (二重側帯波)
DSC	Differential Scanning Calorimeter
DSC	Digital Still Camera (デジタル小型カメラ)
DSM	Dynamic Scattering Mode (液晶の動作方法の一つ)
DSP	Digital Signal Processor (デジタル信号処理プロセッサ)
DSPW	Double Side Polished Wafer (両面研磨ウェーハ)
DSU	Digital Service Unit (ISDNに必要な回線接続装置)
DSW	Direct Stepper in Wafer
DTA	Differential Thermal Analyzer (熱差分析装置)
DTE	Data Terminal Equipment (データ端末装置)
DTL	Diode-Transistor Logic (ダイオードトランジスタ論理回路)
DTP	Desk Top Publishing (電子編集・印刷技術)
DTS	Digital Tuning System
DUT	Device Under Test (被試験体)
D/V	Device (装置)
DVD	Digital Video (Versatile) Disc
DVM	Digital Volt Meter (デジタル電圧計)
DWB	Direct Wafer Bonding (ウェーハ直接接着)
DWDM	Dense Wave Division Multiplexing
DZ	Denuded Zone (無欠陥領域)

\* E

EAROM	Electrically Alterable ROM (電氣的に書換え可能なROM)
EB	Electron Beam (電子ビーム)
EC	Electronic Commerce (電子商取引)
ECD	Electro Copper Deposition (電解銅メッキ)
ECL	Emitter Coupled Logic (エミッタ結合型論理回路)
ECR	Electron Cyclotron Resonance (電子サイクロトロン共鳴)
ECR	Electronic Cash Register (電子レジスタ)
ECS	<u>E</u> lectro <u>c</u> hemical <u>S</u> ociety (電気化学学会)
ECTL	Emitter Coupled Transistor Logic (エミッタ結合型トランジスタ論理回路)
ECU	Electronic Control Unit (電子制御装置)
ED	Export Declaration (輸出申告書)
E/D	Enhancement & Depletion
EDI	Electronic Data Interchange (電子データ交換)
EDMOS	Enhancement Depletion MOS
EDO	Enhanced Data Output (拡張データ出力)
EDP	Electronic Data Processing (電子データ処理)
EDPS	Electronic Data Processing System (電子データ処理システム)
EDTA	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid
EDTV	Extended Definition TeleVision (高画質テレビ)
EDX	<u>E</u> nergy <u>D</u> ispersive <u>X</u> -ray Spectroscopy (エネルギー分散X線分光法)
EE	Engineering Economy
EEC	Electronic Engine Controller (コンピュータを使ったエンジン制御装置)
EEC	Electronic Engineering Center
EEC	European Economic Community (旧欧州経済共同体)
EECA	<u>E</u> uropean <u>E</u> lectronic <u>C</u> omponent Manufacturers Association (欧州電子部品工業会)
E <sup>2</sup> CL	Emitter to Emitter Coupled Logic
EEGR	Electronic Exhaust Gas Recirculation
EEMOS	Enhancement-Enhancement MOS
EEPROM	Electrically Erasable PROM (電氣的消去可能読み出し専用メモリ)
EES	Etching & Encap System
EFEM	Equipment Front End Module
EFI	Electronic Fuel Injection (電子式燃料噴射)
EFS	Electronic Filing System (電子ファイルシステム)
EG	Extrinsic Gettering
EGR	Exhaust Gas Recirculation
EHS	Environment, Health, & Safety (環境 健康と安全)
EI	Engineering Instruction (技術情報標準)
EIA	Electric Industries Association (米国電子工業会)
EIAJ	Electronic Industries Association of Japan (日本電子機械工業会)

EL	Electro Luminescence (電場発光)
E/L	Export License (輸出許可証)
ELAM	Etching Technology Using Long Life Active Species Excited by Microwave
ELTRAN	<u>E</u> pitaxial <u>L</u> ayer <u>T</u> ransfer (SOIウェーハ製法の一つ)
EM	Engineering Memorandum (技術的メモ)
EMC	<u>E</u> lectromagnetic <u>C</u> ompatibilty (電磁界における両立性)
EMI	<u>E</u> lectromagnetic <u>I</u> nterference (電磁干渉 障害)
EMMI	Epoxy Molding Material Institute
EMP	Estimated Material Price (見積材料価格)
EMS	Electronics Manufacturing Service (電子機器の製造受託サービス)
EMS	Environmental Management System (環境マネジメントシステム)
EP	Excellent Products (卓越した商品)
EPD	Etch Pit Density (エッチピット密度)
EPI	Epitaxial Growth (エピタキシャル成長)
EPIC	<u>E</u> lectric Isolation by <u>P</u> oly Crystal <u>I</u> C
EPL	EB Projection Lithography (EB投影露光)
EPMA	Electron Probe Micro Analyzer (電子プローブ微小分析法)
EPOC	<u>E</u> ngineering Efficiency & <u>P</u> roductivity of <u>C</u> oming Age
EPR	Emitter with Poly-Silicon Balanced Resistor
EPROM	Erasable & Programmable ROM (紫外線により消去可能で再書き込みできるROM)
ER	Engineering Report
ERP	Enterprise Resource Planning (総合基幹業務システム)
ERSO	Electronics Research & Service Organization (of Taiwan) (台湾電子工業研究所)
ES	Engineering Sample (技術的サンプル)
ES	Evaluation Sample (評価用サンプル)
ESCA	Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
ESH	Environment, Safety and Healthy (環境 安全 健康)
ESP	Embedded Standard Product (基本回路を埋め込んだウェーハ標準製品)
ESR	Electronic Slide Rule (電子計算尺)
EST	Electronic Spark Timing
ETC	Electronic Toll Collection (ノンストップ自動料金收受システム)
EUV	<u>E</u> xtreme <u>U</u> ltraviolet (遠紫外線)
EV	Electric Vehicle (電気自動車)
EVAP	Evaporation (蒸着)
EXT	Exhaust (排気)
EXT	External (外部)

\* F

FA	Factory Automation (工場内生産の自動化)
FAB	Full Auto Bonder (全自動ワイヤボンダ)
FAM	Full Auto Mounter (全自動チップマウンタ)
FAMOS	<u>F</u> loating <u>G</u> ate <u>A</u> valanche <u>I</u> njection <u>M</u> OS
FAPS	Flexible Automated Production System (フレキシブル自動化生産システム)
FAQ	Frequently Asked Questions (インターネットでよくある質問と回答集)
FBGA	Fine pitch Ball Grid Array (微細化BGA)
FBR	Fast Breeder Reactor (高速増殖炉)
FC	Fine Ceramics (ファインセラミックス)
FC	Flip Chip (フリップチップ)
FCC	Face Centered Cubic
FCC	The Federal Communications Commission (米国通信委員会)
FCCZ	<u>F</u> ull-range <u>R</u> esistivity <u>C</u> ontrolled <u>C</u> Z (抵抗率制御連続引出)
FCN	Function (ファンクション、機能)
FD	Financial Data (財政データ)
FDC	Floppy Disk Controller (フロッピーディスク制御装置)
FDD	Floppy Disk Drive (フロッピーディスク駆動装置)
FDT	Flow Duration Time (樹脂の流れ持続時間)
FED	Field Emission Display (電子放射型平面表示装置)
FEM	Field Effect Mode
FEM	Finite Element Method (有限要素法)
FeRAM	Ferroelectric RAM (強誘電体不揮発性メモリ)
FET	Field Effect Transistor (電界効果トランジスタ)
FF	Fast Forward (早送り)
FF	Flip Flop (フリップフロップ)
FFP	Film Flat Package
FFU	Fan Filter Unit (送風機・フィルター一体化ユニット)
FIB	Focused Ion Beam (集束型イオンビーム)
FIFO	Fast-In, Fast-Out (先入れ先出し、データ記憶の一方式)
FIT	<u>F</u> ailure <u>U</u> nit (故障率の単位、1FIT=10 <sup>-9</sup> /時間)
FM	Flow Meter (流量計)
FM	Frequency Modulation (電波の周波数変調)
FMEA	Failure Mode Effect Analysis (故障モード影響解析)
FMS	File Management System (ファイル管理システム)
FMS	Flexible Manufacturing System (少量多品種生産システム)
FMU	Fan Module Unit
FMV	Fair Market Value (公正市場価格)
FOB	Free On Board (本船渡し)
FOMA	Freedom Of Mobile multimedia Access (NTTドコモの第3世代移動通信サービス)
FOR	Free On Rail (鉄道渡し)

FORTTRAN	<u>F</u> ormula <u>T</u> ranslator (科学技術用高級プログラミング言語)
FOUP	Front Opening Unified Pod (前面開閉型自動化対応ウェーハ容器)
FP	Flat Package (平面リードピン型パッケージ)
FPD	Flat Panel Display (平面型表示装置)
FPD	Flow Pattern Defect (フローパターン欠陥)
FPD	Focal Plane Deviation (設定基準面に対する凹凸の最大値)
FPGA	Field Programmable Gate Array
FP-LD	Fabry Perot Laser Diode (ファブリペロー型半導体レーザ)
FPM	Fast Page Mode (DRAMのアクセス法の一つ)
FPP	Flat Plastic Package (平型樹脂成形外装器)
FQA	Flatness Quality Area (ウェーハの平坦度適用領域)
FR	Failure Rate (故障率)
FRAM	Ferroelectro RAM (不揮発性 ferro RAM)
FRD	Fast Recovery Diode (高速レクチファイヤ)
FRP	Fiber Reinforced Plastic (繊維強化プラスチック)
FS	Feasibility Study (企業化調査)
FS	Future System
FSK	Frequency Shift Keying (周波数偏移方式の)
FT	Factor by Thickness
FT	Field Test (実装試験)
FT	Transition Frequency
FTG	Film Thickness Gauge (薄膜厚さゲージ)
FTIR	<u>F</u> ourier <u>T</u> ransform <u>I</u> nfrared Spectroscopy (フーリエ変換赤外分光法)
FTP	Fast Thermal Process
FTP	File Transfer Protocol (ファイル転送方式)
FTTH	Fiber To The Home (家庭への光ファイバー)
FU	Function Unit (機能単位)
FY	Fiscal Year (会計年度)
FZ	Floating Zone (Method) (帯域溶法: 単結晶製造の一方法)

\* G

G	Gross (総体)
GA	Gate Array (ゲートアレイ、セミカスタムLSI)
GALS	Generalized Assembly Line Simulator
GAP	Garium Phosphide (ガリウムりん)
GATT	General Agreement on Tariffs & Trade (関税と貿易に関する一般協定)
GBIR	Global, Backsurface-reference, Ideal plane, Range
GC	Gas Chromatograph (ガスクロマトグラフ)
GCS	Gate Controlled Switch (GTOサイリスタ)
GDP	Gross Domestic Product (国内総生産)
GEMFET	Gain Enhancement Mode FET
GF3D	Global, Frontsurface-reference, 3-point, Deviation
GFA	Gas Fusion Analysis (ガス溶解化分析)
GGI	Gold to Gold Interconnection (基本的なフリップチップの接合法)
GGG	Gadolinium Gallium Garnet (ガドリニウム・ガリウム・ガーネット)
GHG	Green House Gas (温室効果ガス)
GIF	Graphics Interchange Format (パソコン通信用画像フォーマット)
GIOR	General Input Output Register
GNL	General
GNP	Gross National Product (国民総生産)
GOA	Global Outstanding Assessment (衝突安全ポディー)
GOI	Gate Oxide Integrity (ゲート酸化膜耐圧)
GOPS	Giga Operation per Second
GPS	Global Positioning System (全球位置把握システム)
GPSS	General Purpose Simulation System (シミュレーション言語)
GR	Growth Rate (成長率)
GSI	Giant Scale Integration (巨大規模集積化)
GT	Group Technology (類似部品加工法)
GTO	Gate Turn-Off Thyristor (自己消弧型整流素子)
GTR	Giant Transistor (大電力トランジスタ)
GUI	Graphical User Interface (対話型画像処理インターフェース)
GW	Gross per Wafer
GWP	Global Warming Potential (地球温暖化係数)

\* H

HAI	Hydrogen Annealed Intrinsic Gettering (ウェーハの水素処理)
HB	Holizortal Bridgeman
HBT	Heterojunction Bipolar Transistor (異接合トランジスタ)
HC	Hydrogen Chloride (塩化水素)
HDD	Hard Disk Drive (ハードディスク装置)
HDTV	<u>H</u> igh <u>D</u> efinition <u>T</u> ele <u>v</u> ision (高品位テレビジョン)
HED	High Efficiency Diode (高速高効率整流素子)
HEMT	High Electron Mobility Transistor (高電子移動度トランジスタ)
HEPA	High Efficiency Particulate Air (高効率微粒子除去用)
HF	High Frequency (高周波)
HFC	Hybrid Functional Circuit
HFC	<u>H</u> ydro <u>f</u> luoro <u>C</u> arbon (代替フロンの一つ)
H <sup>3</sup> IT	<u>H</u> igh Density & <u>H</u> igh Power <u>H</u> ybrid <u>I</u> ntegration <u>T</u> echnology
HI	Human Interface (マンマシンインタフェース)
HIC	Hybrid Integrated Circuit (混成集積回路、ハイブリッドIC)
HIP	Hot Isostatic Press (熱間静水圧プレス)
HIV	Human Immunodeficiency Virus (ヒト免疫不全ウイルス)
HML	Half Mirror Lapping (半鏡面ポリッシング)
HMSL	High Mount Stop Lamp (自動車の後高部ブレーキランプ)
HPF	High Pressure Filter
HSC	High Speed Combined System (高速度組立工程連結システム)
HTML	Hyper Text Markup Language (ウェブページ作成編集用語)
HTL	High-Threshold Logic
HTRB	High Temperature Reverse Bias (高温逆バイアス)
HTTL	High Speed Transistor-Transistor Logic (高速TTL)
http	Hyper Text Transport Protocol (wwwサーバとクライアントのプロトコル)
HV	High Voltage Power Transistor (高耐圧水平出力トランジスタ)

\* I

I300I	International 300mm Initiative
IACS	International Annealed Copper Standard
IBP	Internal Billed Price
IBT	<u>I</u> on- <u>I</u> mplanted <u>B</u> ase <u>T</u> ransistor Technology
IC	Integrated Circuit(集積回路 通称アイシー)
IC	Ion Chromato-graphy
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (誘導結合プラズマ質量分析器)
ICU	Interface Control Unit(インターフェース制御装置)
ID	<u>I</u> dentification(識別 認識番号)
ID	Industrial Dynamics
ID	Inner Diameter(内径)
IDM	Integrated Device Manufacturer(垂直統合型LSIメーカー)
IE	Industrial Engineering(生産技術)
IEC	International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)
IEDM	International Electron Devices Meeting(国際電子デバイス学会)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気・電子技術者協会)
IEGT	Injection Enhanced Gate Transistor
IF	Intermediate Frequency(中間周波数)
IFD	<u>I</u> nter <u>F</u> ace <u>D</u> river
IG	Intrinsic Gettering(内部からの不純物ゲッターリング)
IGT	Insulated Gate Transistor
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor(絶縁ゲート型トランジスタ)
IH	Induction Heating(誘導加熱)
I <sup>2</sup> L	Integrated Injection Logic(飽和型論理回路素子)
I <sup>2</sup> P	Ion Implantation Process(イオン注入工程)
I <sup>3</sup> L	Isoplanar Integrated Injection Logic
I/L	Import Licence(輸入許可証)
ILB	Inner Lead Bonder(TABの内部リードボンダ)
ILIC	Import Liberalization of IC
IM	Information Memorandum(技術情報メモ)
IM	Ion Milling(イオンによる加工)
IMA	Ion Micro Analyzer(イオンによる微小分析装置)
IME	Input Method Editor(Windowsの文字入力用ソフトウェア)
IMMA	Ion Microprobe Mass Analysis
IMPATT	<u>I</u> mpact Ionization <u>A</u> valanche & <u>T</u> ransit <u>T</u> ime
IMPLA	Ion Implantation(イオン注入)
INS	Information Network System
IO	Input, Output
I/O	Input & Output(入出力)

IOP	Input Output Processer (入出力処理装置)
IP	Intellectual Property (知的財産 著作権)
IP	Internet Protocol (インターネットプロトコル)
IPA	Isopropyl Alcohol (イソプロピルアルコール)
IPCD	Intelligent Power Control Device (集積型電力制御素子)
IPD	Intelligent Power Device (集積型電源素子)
IPM	Intelligent Power Module (集積型電源モジュール)
IPOS	Isolation by Oxidized Porous Silicon
IPS	Instantaneous Power Supply
IPv6	Internet Protocol version 6 (次世代インターネット通信方式)
IR	Information Retrieval (情報検索)
IR	<u>I</u> nfr <u>u</u> red (赤外)
ISDN	Integrated Services Digital Network (統合デジタル通信網)
ISHM	International Society for Hybrid Microelectronics
ISIR	Initial Sample Inspection Report
ISO	International Organization for Standardization (国際標準化機構)
ISP	Internal Sales Price (企業内売価)
ISP	Internet Service Provider (インターネットサービスプロバイダ)
ISS	Industry Strategy Symposium
ISSCC	International Solid State Circuit Coference (国際固体電子回路会議)
ISSM	International Symposium on Semiconductor Manufacturing (半導体製造国際シンポジウム)
ISV	Independent Software Vender (独立系ソフトウェア販売社)
IT	Information Technology (情報技術 情報産業)
ITM	Implantation Through Metal
ITO	Indium Tin Oxide (インジウム・錫酸化物)
ITOX	<u>I</u> nternal <u>T</u> hermal <u>O</u> xidation
ITRI	Industrial Technology Research Institute (台湾工業技術研究院)
ITS	Intelligent Transportation System (高度道路交通システム)
IVH	Interstitial Via Hole (インナーバイアホール)

\* J

JAN	Japanese Article Number (日本国内の標準規格バーコード)
JCR	Junction Coating Resin (接合保護用樹脂)
JEDEC	Joint Electron Device Engineering Council
JEIDA	Japan Electronic Industry Development Association (日本電子工業発展協会)
JEITA	Japan Electronics and Information Technology Industries Association (電子情報技術産業協会)
JESSI	Joint European Semiconductor Silicon Initiative (欧州次世代半導体開発共同事業体)
JETRO	Japan External Trade Organization (日本貿易振興会)
JIS	Japanese Industrial Standards (日本工業規格)
JIT	Just in Time (ジャストインタイム ジット)
JJ	Josephson Junction (ジョセフソン接合)
JPC	Japan Patent Classification (日本特許分類)
JPEG	Joint Photographic Experts Group (カラー画像符号化方式の国際標準)
JSNM	Japan Society of Newer Metals (社団法人新金属協会)
JST	Japan Standard Time (日本標準時)
JSTM	Japan Society for Testing Materials (日本材料試験協会)
JV	Joint Venture (共同企業体)

\* K

KEC	KOREA Electronics Co. (韓国電子株式会社)
KFS	Key for Success (成功への鍵)
KGD	Known Good Die (品質保証したベアチップ)
KING	Key-technology Innovation for Next Generation Si-crystal
KPR	Kodak Photo Resist (コダック感光剤)
KSIA	Korea Semiconductor Industry Association (韓国半導体産業協会)
KUBIC	Kitakyusyu Works Bipolar IC

\* L

LAN	Local Area Network (構内情報通信網)
LAP	Longitudinal Acoustic Phone
LASER	<u>L</u> ight <u>A</u> mplification by <u>S</u> timulated <u>E</u> mission of <u>R</u> adiation (レーザ)
LBP	LASER Beam Printer (レーザビームプリンタ)
LC	Liquid Crystal (液晶)
L/C	Letter of Credit (信用状)
LCA	Life Cycle Assessment (製品の製造から廃棄まで)
LCA	Low Cost Automation (低価格な自動化)
LCC	Leadless Chip Carrier (リードの無い表面実装タイプのLSI外囲器)
LCC	Life Cycle Cost
LCD	Liquid Crystal Display (液晶表示装置)
LCL	Lower Control Limit (下部管理限界)
LCP	Liquid Crystal Polymer (液晶重合体)
LCS	Layout Check Service
LD	Laser Diode (半導体レーザ用ダイオード)
LDD	Lightly Doped Drain
LDIP	Large DIP
LEC	Liquid Encapsulated Czochralski (液体カプセル法引上げ)
LED	Light Emitting Diode (発光ダイオード)
LEM	Light Element Mounter (光部品マウンター)
LID	Leadless Inverted Device (リードの無い樹脂シール型セラミック外囲器)
LLCP	Leadless Low Cost Package
LLD	Leadless Diode (面実装タイプのダイオード)
LLL	Low Level Logic
LOC	Lead on Chip (半導体チップ上にリードを接着する方式)
LOCOS	<u>L</u> ocal <u>O</u> xidation of <u>S</u> ilicon (選択酸化法)
LP	Line Printer (ラインプリンタ)
LP	Linear Programming (線形プログラミング)
LP	List Price
LPCVD	Low Pressure CVD (減圧CVD)
LPD	Light Point Defect (明視野点欠陥)
LPE	Liquid Phase Epitaxy (液相エピタキシャル)
LPF	Low Pass Filter
LS	Labour Saving (労働省力)
L/S	Line and Space (配線と線間寸法)
LSB	Least Significant Bit (最下位ビット)
LSI	Large Scale Integration (大規模集積回路)
LSIP	Large SIP
LSTD	Laser Scattering Tomography Defect (赤外散乱体)
LSTTL	Low Power Schottky TTL (低消費電力ショットキTTL)

LT	Lead Time (製造工程間必要時間)
LTP	Low Temperature Passivation (低温処理保護膜形成)
LTPD	Lot Tolerance Percent Defective
LTST	Liquid Thermal Shock Test (液体熱衝撃試験)
LTT	Light Triggered Thyristor (光点弧型サイリスタ)
LTV	Local Thickness Variation (セル寸法内の厚さバラツキ)

\* M

MA	Micro Assembly (微細組立)
M&A	Merger & Acquisition (企業の合併・買収)
MACH-GD	Manufacturing Aimed Compact & Half by Grand Design
MAOS	Metal Alumina Oxide Semiconductor
MAP	Manufacturing Automation Protocol (製造の自動化に関する通信規約)
MAPS	Mixed Assembly Production System (混合組立生産システム)
MAS	Metal Alumina Semiconductor (絶縁膜にアルミナを使った半導体)
MB	Mechanical Bevel (砥石使用ベベル)
MBA	Master of Business Administration (経営学修士)
MBE	Molecular Beam Epitaxy (分子線エピタキシャル法)
MBO	Management By Objective (目標管理制度)
MC	Machining Center (複合加工工作機械)
M/C	Machine (機械 装置)
MCD	<u>M</u> otor <u>S</u> peed <u>C</u> ontrol & <u>D</u> river
MCL	Metal Contamination Level (金属汚染レベル)
MCM	<u>M</u> ultichip <u>M</u> odule (複数半導体チップ搭載モジュール)
MCP	<u>M</u> ultichip <u>P</u> ackage (複数半導体チップ搭載パッケージ)
MCU	MicroController Unit (ワンチップマイコン)
MCZ	<u>M</u> agnetic-field-applied <u>C</u> zochralski (磁界印叫上げ)
MD	Material Data (標準部品データ)
MD	Mini Disc (小型光磁気ディスク)
MDI	Mask Defect Inspector (マスク欠陥検査装置)
MDT	Mean Down Time (平均故障時間)
MDT	Multi Digit Tube (多桁表示管)
MDTL	Modified Diode-Transistor Logic
ME	Management Engineering (管理工学)
ME	Medical Engineering (医療工学)
ME	Micro Electronics (微細電子工学)
MELF	<u>M</u> etal <u>E</u> lectrodes <u>F</u> acebonding (金属電極付き表面実装素子)
MEMS	<u>M</u> icro <u>E</u> lectromechanical <u>S</u> ystem (微小電気機械システム)
MES	<u>M</u> etal <u>S</u> emiconductor
MET	Mesh Emitter Transister (網目状エミッタ型トランジスタ)
MFC	Mass Flow Controller (流量制御装置)
MFC	Molded Flip Chip
MFG-SPEC	<u>M</u> anufacturing <u>S</u> pecification (製造基準)
MFP	Mini Flat Package (小型フラットパッケージ)
MH	Material Handling
MIC	Microwave Integrated Circuit (マイクロ波用IC)
MIDI	Musical Instrument Digital Interface (電子楽器やコンピュータ間で演奏データをやりとりするための規格)

MIL-STD	Military Standard (米国軍用標準)
MIM	Metal-Insulator-Metal (金属 絶縁物 金属の構造)
MIP	Metal Induced Pitting
MIPS	Million Instructions per Second (1秒間あたり100万回の命令実行)
MIS	Management Information System (経営情報システム)
MIS	Metal Insulator Semiconductor (MOS構造の基本)
MITI	Ministry of International Trade and Industry (通商産業省)
ML	Micro Lithography (微細露光技術)
ML	Mirror Lap (鏡面研磨)
MLSW	Multi-Layer Silicon Wafer (多層シリコンウェーハ)
MMIC	Monolithic Microwave IC (モノリシックマイクロ波IC)
MMST	Microelectronics Manufacturing Sciences and Technology
MMX	<u>M</u> ulti <u>M</u> edia <u>e</u> xtension (マルチメディア機能拡張技術)
MNOS	Metal Nitride Oxide Semiconductor (窒化膜と酸化膜をメタルの下に用いた半導体)
MO	Magneto Optical disk (光磁気ディスク)
MOCVD	<u>M</u> etal <u>o</u> rganic CVD (有機金属化学気相成長法)
MODEM	<u>M</u> odulator <u>D</u> emodulator (データ伝送用変調・復調器)
MOS	Management Operating System
MOS	Metal Oxide Semiconductor (金属と酸化膜による半導体 通称:モス)
MP	Mass Production (大量生産)
MP	Melting Point (融点)
MP	Micro Processor (小型プロセッサ)
MP3	<u>M</u> PEG1 Audio Layer <u>3</u> (音声データの圧縮技術の国際規格)
MPEG	Moving Picture Expert Group (カラー動画画像蓄積用符号化方式)
MPSOLN	Modified Pliskin Solution
MPU	Micro Processing Unit (超小型演算処理装置)
MPX	<u>M</u> ultiplex (多重化装置)
MQW	Multi-Quantum Well (多重量子井戸)
MRC	Metal Research Co.
MRI	Magnetic Resonance Imaging (核磁気共鳴画像法)
MROM	Mask ROM (露光用マスクで情報を書き込んだROM)
MRP	Material Requirement Planning
MSB	Most Significant Bit (最上位ビット)
MS-DOS	<u>M</u> icro <u>s</u> oft- <u>D</u> isk <u>O</u> peration <u>S</u> ystem (パソコンの標準OS)
MSI	Medium Scale Integrated Circuit (中規模集積回路)
MSP	Micro Shallow Pit
MSS	Master Specification Sheet (主規格表)
MT	Magnetic Tape (磁気テープ)
MTBF	Mean Time Between Failure (平均故障間隔時間)

MTL	Merged Transistor Logic
MTM	Method Time Measurement (時間観測法)
MTS	<u>M</u> ulti <u>t</u> ablet <u>M</u> olding <u>S</u> ystem (マルチタブレット樹脂モールド装置)
MTTF	Mean Time to Failure (平均無故障稼働時間)
MTTR	Mean Time to Repair (修理までの平均時間)
MUSE	<u>M</u> ultiple <u>S</u> ub-nyquist Sample <u>E</u> ncoding (映像信号帯域圧縮方式)
MUX	<u>M</u> ultiplex <u>e</u> r (多重化装置)
MVA	Multi-domain Vertical Alignment (改善された液晶の一種)

\* N

NA	Numerical Aperture (レンズ開口数)
NAND	Not AND (否定論理積)
NASA	National Aeronautics and Space Administration (米国航空宇宙局)
NASDA	National Space Development Agency of Japan (日本宇宙開発事業団)
NB	Neutron Bombardment
NC	Numerical Control (数値制御)
NCF	Non Conductive resin Film (導電性粒子のない絶縁フィルム)
NCP	Non Conductive resin Paste (導電性粒子のない絶縁ペースト)
NCS	Network Computing System
ND	Neutron Doping (中性子によるドーピング)
NDT	<u>N</u> on <u>d</u> estructive <u>I</u> esting (非破壊試験)
NEDO	New Energy and Industrial Technology Development Organization (新エネルギー・産業技術総合開発機構)
NEGA	Negative Resist (ネガ型レジスト (感光剤))
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
NERIM	Nonvolatile Electrically Rewritable IC Memory (不揮発性書き込み可能メモリ)
NF	Noise Figure (雑音指数)
NGO	Non Governmental Organization (非政府間組織)
NH	Nail Head (くぎの頭型)
NICS	<u>N</u> ewly <u>I</u> ndustrializing <u>C</u> ountries (新興工業国地域群)
NIES	Newly Industrializing Economies (新興工業経済群)
NIS	National Information System
NIST	National Institute of Standards and Technology (米国標準・技術研究所)
NMOS	<u>N</u> egative-Channel <u>M</u> OS
NMP	N-Methyl-2-Pyrrolidone
NMR	Nuclear Magnetic Resonance (核磁気共鳴)
NOX	Nitrogen Oxide X (窒素酸化物)
NSA	Nitride Self Aligned Process (窒化膜による自己整合化プロセス)
NSS	Network Software Service
NTC	<u>N</u> iigata <u>I</u> Toshiba <u>C</u> eramics Co., Ltd.
NTD	Neutron Transmutation Doping (中性子照射ドーピング)
NTL	Non Threshold Logic
NTRS	National Technology Roadmap for Semiconductor
NTSC	National Television System Committee (国際テレビシステム委員会)
NV	Needle Valve
NVRAM	Non Volatile RAM (低電圧駆動不揮発性メモリ)

\* O

OA	Office Automation (事務作業合理化)
OAT	Oxide Aligned Transistor
OBIC	Optical Beam Induced Current
OC	Operating Characteristic
OCD	Ohka Coat Diffusion Source (東京応化塗布型拡散源)
OCD	Optically Coupled Device (光結合素子)
OCR	Optical Character Reader (光学式文字読取装置)
OD	Operation Data (標準工程データ)
OD	Outer Diameter (外径)
ODA	Official Development Assistant (政府開発援助)
ODU	Out Door Unit (衛星放送受信用屋外装置)
OEE	Overall Equipment Effectiveness
OEIC	Opto-Electronic Integrated Circuit (光電子IC)
OEM	Original Equipment Manufacturing (相手先ブランドでの生産)
OES	Optical Emission Spectroscopy (発光分光分析)
OF	Orientation Flat
OHP	Over Head Projector
OHT	Overhead Hoist Transport (天井走行搬送)
OI	Optical Isolator
OJB	Over Junction Bonding (チップの接合上ボンディング)
OJT	On the Job Training (業務中訓練)
OLB	Outer Lead Bonder (TABの外部リードボンディング装置)
OLLM	On-Line Layout Modification
OMR	Optical Mark Reader (光学式マーク読取装置)
OPC	Optical Photo Coupler (LEDを使用した無接点リレー)
OPC	Organic Photoconductor (有機光導電体)
OPEC	Organization of Pacific Economic Cooperation (太平洋地域経済協力機構)
OPP	Optical Precipitate Profiler (赤外干渉法)
OR	Operations Research
OS	Operating System
OS	Oxidation & Sirtl
OSC	Oscillator (発振)
OSE	One Side Etching (片面エッチング)
OSE	Orient Semiconductor Electronics Ltd.
OSF	Oxidation Induced Stacking Fault (酸化誘起積層欠陥)
OSL	One Side Lapped (片面ラップド)
OX	Oxidation (酸化)

\* P

PA Product Analysis  
PAAS Plastic Power Transistor Automatic  
Assembly System  
PAC Passivation on IC  
PAC Performance Analysis & Control  
PACE Plasma Assisted Chemical Etching  
PAL Phase Alternation by Line (テレビの信号伝送のバブル方式)  
PALC Plasma Address Liquid Crystal (プラズマアドレス液晶)  
PAM Pulse Amplitude Modulation (パルス振幅変調)  
PAP Power Device All Diffusion Plan  
PARCOR Partial Auto Correlation (偏自己相関係数方式)  
PAT Production Approval Test (生産認定試験)  
PATOLIS Patent Online Information System (特許のオンラインデータベース)  
PBN Pyrolytic Boron Nitride  
PBS Poly Silicon Backside Seal (ポリシリコンによるウェーハ裏面コート)  
PBT Poly Butylene Terephthalate (ポリブチレンテレフタレート)  
PBX Private Branch eXchange (構内電話交換機)  
PC Personal Computer (パーソナルコンピュータ、パソコン)  
PC Poly Carbonate (ポリカーボネート)  
PC Printed Circuit (回路基板)  
PC Proposal for Change  
PCB Poly Chlorinated Biphenyl (ポリ塩化ビフェニル)  
PCB Printed Circuit Board (プリント基板)  
PCBT Pressure Cooker Bias Test  
PCD Plasma Coupled Device (プラズマ結合型素子)  
PCD Pitch Circle Diameter  
PCM Precise Control Molding (精密制御モールド)  
PCM Pulse Code Modulation (パルス符号変調)  
PCS Punch Card System (パンチカードシステム)  
PCT Perfect Crystal Device Technology (完全結晶による製造技術)  
PCT Pressure Cooker Test (圧力釜試験)  
PD Potting Diode (ポッティングダイオード)  
PDA Personal Digital Assistant (個人用携帯型情報端末)  
PDC Personal Digital Cellular (セルラーホンの通信方式)  
PDF Portable Document Format (電子ドキュメントファイル方式)  
PDP Plasma Display Panel (プラズマ型平面表示装置)  
PE Photo Engraving (写真食刻)  
PE PolyEthylene (ポリエチレン)  
PEB Post Exposure Bake (露光後ベーク)  
PEEK Poly-ether-ether Ketone (ポリエーテルエーテルケトン)  
PEEL Programmable Electrically Erasable Logic

PEP	Photo Engraving Process (写真食刻プロセス)
PERT	Program Evaluation and Review Technique (科学的工程管理法)
PES	Poly Ether Sulfone
PET	Poly Ethylene Terephthalate (PETボトルなど)
PFC	<u>P</u> er <u>f</u> luoro <u>c</u> arbon (代替フロン)
PG	Pressure Gauge (圧力計)
PGA	Pin Grid Array (リード挿入型多ピン外囲器)
PGV	Person Guided Vehicle (作業者運転搬送車)
PHS	Personal Handyphone System (簡易型携帯電話)
PI	Polyimide (ポリイミド)
PI	Purchasing Inspection
PIC	Production Information & Better Control
PIM	Personal Information Manager (個人情報管理機能の総称)
PIQ	Polyimide Isoindlo Quinasolinzion
PKG	<u>P</u> ack <u>a</u> ge (外囲器)
PKS	Polyketone Sulfide
PL	Photo Luminescence (光励起発光法)
PL	Product(s) Liability (製造物責任、製品責任)
PL	Profit or Loss (損益)
PLA	Programmable Logic Array
PLAS	High <u>P</u> erformance Bipolar <u>L</u> SI Process for <u>A</u> nalog <u>S</u> ystem
PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier
PLD	Programmable Logic Device (プログラム可能な論理素子)
PLL	Phase Locked Loop (定周波発振方式の一つ)
PLP	Product(s) Liability Prevention (製造物責任予防)
PM	Phase Modulation (位相変調)
PM	Preventive Maintenance (予防保守)
PMA	Product Market Analysis
PMDC	Premanagement Development Course
PMMA	<u>P</u> oly <u>m</u> ethyl <u>m</u> eth <u>a</u> crylate (メタアクリル酸メチル)
PMOS	Positive-Channel MOS (Pチャンネル型MOS)
PO	Postal Order (郵便為替)
POEM	<u>P</u> lanarized Silicon <u>O</u> xide Technology for <u>E</u> nhanced Multilevel <u>M</u> etalization
POP	Post Office Protocol (メールを保管したり取り出すための処理手順)
POS	Point of Sales (販売時点情報管理)
POSI	Positive Resist (ポジ型レジスト(感光剤))
POST	Perfect Oxidation Shallow Trench
PP	<u>P</u> oly <u>p</u> roplene (ポリプロピレン)
PPA	Preproduct Purchasing Analysis
PPBS	Planning Programming Budgetting System (企画計画予算制度)

PPC	Plain Paper Copier (普通紙複写機)
ppm	Parts Per Million (百万分率)
PPM	Prints Per Minute (1分当たりのプリント枚数)
PPM	Pulse Position Modulation (パルス位置変調)
PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernet (PPの機能をEthernetを通して利用するためのプロトコル)
PPS	<u>P</u> oly <u>p</u> henylene <u>S</u> ulfide
ppt	Parts Per Trillion (1兆分率)
PPU	Pre Purification Unit
PROM	Programmable ROM (書込み可能ROM)
PROX	Proximity (接近露光法)
PSA	Pressure Swing Adsorption
PSF	P-IF Surface-wave Filter (映像中間周波表面波フィルタ)
PSG	Phospho-Silicate Glass (リン・ケイ酸ガラス)
PSI	Pounds per Square Inch (平方インチ当たりポンド)
PSID	<u>P</u> hotoconductive Layered <u>S</u> olid State <u>I</u> maging <u>D</u> evice
PSL	<u>P</u> olystyrene <u>L</u> atex (ポリスチレンラテックス)
PTH	Plated Through Hole (メッキ付きスルーホール)
PTP	Paper Thin Package (紙より薄いパッケージ)
PTS	Predetermined Time Standards
PUA	Percent of Usable Area (半導体チップの使用可能域率)
PVC	<u>P</u> oly <u>v</u> inyl <u>c</u> hloride (ポリ塩化ビニール)
PVD	Physical Vapor Deposition (物理的蒸着法)
PWB	Printed Wiring Board (プリント基板)
PWM	Pulse Width Modulation (パルス幅変調)
PY	Process Yield (工程歩留)

\* Q

QA	Quality Assurance (品質保証)
QAT	Quality Approval Test (品質認定試験)
QC	Quality Control (品質管理)
QCD	Quality, Cost, Delivery (品質、価格、納期)
QCS	Quality Control Standard (品質管理標準)
QDC	Quick Die Changer (簡単金型交換装置)
QFD	Quality Function Deployment (品質機能展開)
QFJ	Quad Flat J-leaded Package (PLCC)
QFN	Quad Flat Non-leaded Package (リードなしQFP)
QFP	Quad Flat Package (表面実装型4方向リード外周器)
QIL	Quad Inline Package LSI
QMRS	Quality Memorandum Retrieval System (品質情報検索システム)
QSS	Surface Charge Density (表面電荷密度)
QTAT	Quick Turn Around Time (製品開発・試作期間短縮)
QVIP	Quality-Very Important Problem

* R	
RA	Rectifier Assembly (整流素子組立製品)
RAM	Random Access Read Write Memory (随意読出し・書込み可能メモリ)
RAS	Remote Access Server (遠隔接続サーバ)
RCJ	Reliability Center for Electronic Components of Japan (日本電子部品信頼性センター)
RCSP	Real Chip Size Package (真のチップ大パッケージ)
RCT	Reverse Conductive Thyristor (逆導通サイリスタ)
RD	Regulation for Semiconductor Division (東芝半本規定)
RESURF	Reduced Surface Field
REG	Regular Life Test (通常寿命試験)
REL	Resolution Enhanced Lithography
RF	Radio Frequency (無線周波数)
RFP	Resistive Field Plate
RGB	Red, Green, Blue (光の3原色)
RH	Relative Humidity (相対湿度)
RI	Radio Isotope (放射性同位元素)
RIE	Reactive Ion Etching (反応性イオンエッチング)
RIM	Reaction Injection Molding
RISC	Reduced Instruction Set Computer (縮小命令セットコンピュータ)
RLG	Radio <sub>l</sub> uminography
RO	Reversible Osmosis (逆浸透)
ROE	Return On Equity (株主資本利益率)
ROI	Return on Investment (投資収益率)
ROM	Read Only Memory (読み出し専用メモリー)
ROS	Return on Sales (売上高収益率)
RPG	Roll Plating Game (ロールプレーイングゲーム)
RPM	Revolutions Per Minute (1分当たりの回転数)
RPT	Raw Process Time (実質工程時間)
RROM	Rewritable ROM (再書き込み可能ROM)
RS	Regulation for Semiconductor Division (東芝半本規定)
RSM	Random Sequential Memory
RT	Room Temperature (室内温度)
RTA	Rapid Thermal Annealing (急速加熱アニール)
RTO	Rapid Thermal Oxidation (急速高温酸化)
RTP	Rapid Thermal Processing (急速加熱処理)
RTR	Ready to Run
RTV	Room Temperature Vulcanization (室温硫化型)
RV	Recreational Vehicle (レクリエーション用自動車)

\* S

SA	Societe Anonyme (仏:株式会社)
SABIS	Stand Alone Breakerless Ignition System
SAC	Self Align Contact (自己整合法による取出し電極用開口部)
SAG	Self Aligning Gate (ゲート自己整合構造)
SAINT	Self Align Implantation for N <sup>+</sup> Layer Technology
SAL	<u>S</u> elf <u>A</u> ligned I <sup>2</sup> L (自己整合I <sup>2</sup> L)
SAM	Sequential Access Memory (磁気テープのようなメモリ)
SAMOS	Stacked Gate Avalanche Injection MOS
SAR	Segment Address Register (セグメントの番地を示すレジスタ)
SAW	Surface Acoustic Wave (表面弾性波)
SBC	Standard Buried Collector (埋込みコレクタを使用するICの標準構造)
SBD	Schottky Barrier Diode (ショットキバリアダイオード)
SBIR	Site, Backsurface-reference, Ideal plane, Range
SBM	System Block Module (積層化高密度モジュール)
SBT	Schottky Barrier Gate FET
SC	Standard Cell (スタンダードセル)
SC1	Standard Cleaning 1 (半導体標準洗浄法の一つ)
SCA	Surface Charge Analyzer (表面帯電測定装置)
SCCM	Standard Cubic Centimeter per Minutes (cm <sup>3</sup> /分)
SCM	<u>S</u> uper <u>c</u> onducting <u>M</u> agnet (超電導磁石)
SCM	Supply Chain Management
SCR	Semiconductor Controlled Rectifier (サイリスタ)
SCR	Silicon Controlled Rectifier (シリコン制御整流素子)
SCSI	Small Computer System Interface (スカジー: 周辺機器接続規格)
SD	Standard Deviation (標準偏差)
SDRAM	Synchronous DRAM (クロックに同期して動作する高速DRAM)
SE	System Engineer (コンピュータシステムの設計者)
SEAJ	Semiconductor Equipment Association of Japan (社団法人 日本半導体製造装置協会)
SEC	Security Export Control
SECAM	Sequential Colours A Memoire (テレビ放送方式の一つ)
SECS	SEMI Equipment Communication Standards
SELETE	<u>S</u> emiconductor <u>L</u> eading <u>E</u> dge Technologies (半導体先端テクノロジーズ)
SEM	Scanning Electron Microscope (走査型電子顕微鏡)
SEM	Surface Electron Microscope (表面電子顕微鏡)
SEMATECH	<u>S</u> emiconductor <u>M</u> anufacturing <u>T</u> echnology Consortium (米国半導体技術開発組織)
SEMI	Semiconductor Equipment & Materials International (国際半導体製造装置・材料協会)

SEPOX	<u>S</u> elective <u>P</u> oly- <u>S</u> ilicon <u>O</u> xidation
SF	<u>S</u> piral <u>F</u> low(渦巻き状流れ)
SFQD	<u>S</u> ite, <u>F</u> rontsurface-reference, site least s <u>Q</u> uares, <u>D</u> eviation
SFQR	<u>S</u> ite, <u>F</u> rontsurface-reference, site least s <u>Q</u> uares, <u>R</u> ange
SG	<u>S</u> lide <u>G</u> ate(スライドゲート)
SH	<u>S</u> ulpheric <u>H</u> ydrogen <u>P</u> eroxide
SHA	<u>S</u> pecial <u>H</u> igh <u>P</u> ressure <u>A</u> ir(特別高圧縮空気)
SI	<u>S</u> ampling <u>I</u> nspection(抜取り検査)
SI	<u>S</u> uper <u>I</u> ntegration(超集積化)
SI	<u>S</u> ysteme <u>I</u> nternationale d'Unites(仏:国際単位系)
SIA	<u>S</u> emiconductor <u>I</u> ndustry <u>A</u> ssociation(米国半導体工業会)
SICAS	<u>S</u> emiconductor <u>I</u> nternational <u>C</u> apacity Statistics(世界半導体生産キャパシティ統計)
SICOS	<u>S</u> idewall <u>B</u> ase <u>C</u> ontact <u>S</u> tructure
SIMOX	<u>S</u> eparation by <u>I</u> mplanted <u>O</u> xxygen(シリコン中に酸素を打込み酸化膜を形成する方法)
SIMS	<u>S</u> econdary <u>I</u> on <u>M</u> ass <u>S</u> pectroscopy(二次イオン質量分析法)
SIO	<u>S</u> low- <u>I</u> n, <u>S</u> low- <u>O</u> ut
SiP	<u>S</u> ystem in <u>P</u> ackage(既存のチップを組合す高密度化)
SIP	<u>S</u> ingle <u>I</u> nline <u>P</u> ackage(一方向にリードが出ている外囲器)
SIPIC	<u>S</u> emi- <u>W</u> ell <u>I</u> solation & <u>I</u> mplanted <u>P</u> oly- <u>S</u> i Process for High Voltage <u>I</u> C
SIPOC	<u>S</u> emi- <u>I</u> nsulated <u>P</u> oly- <u>C</u> arborundum
SIPOS	<u>S</u> emi- <u>I</u> nsulated <u>P</u> olycrystalline <u>S</u> ilicon
SIRIJ	<u>S</u> emiconductor <u>I</u> ndustry <u>R</u> esearch Institute Japan(半導体産業研究所)
SIS	<u>S</u> emiconductor on <u>I</u> nsulating <u>S</u> ubstrate
SIT	<u>S</u> tatic electricity <u>I</u> nduction <u>T</u> ransistor(静電誘導トラ)
SL	<u>S</u> eed <u>L</u> ifting <u>S</u> peed(結晶引上げ速度)
SLT	<u>S</u> ingle <u>L</u> ane <u>T</u> ransit(自動運搬軌道シャトルバス)
SLT	<u>S</u> olid <u>L</u> ogic <u>T</u> echnology(固体論理技術)
SMC	<u>S</u> urface <u>M</u> ount <u>C</u> omponent
SMD	<u>S</u> imple <u>M</u> old <u>D</u> ie(簡易モールド金型)
SMD	<u>S</u> urface <u>M</u> icro <u>D</u> efect(ウェーハ表面微小欠陥)
SMD	<u>S</u> urface <u>M</u> ount <u>D</u> evice(表面実装素子)
SMI	<u>S</u> tanford <u>M</u> icrosystems <u>I</u> nc.
SMIF	<u>S</u> tandard <u>M</u> echanical <u>I</u> nter <u>f</u> ace
SMPD	<u>S</u> urface <u>M</u> icro <u>P</u> articles & <u>D</u> efects(表面微小パーティクルと欠陥)
SMQ	<u>S</u> uper <u>M</u> ini <u>Q</u> uad <u>L</u> ead
SMT	<u>S</u> urface <u>M</u> ount <u>T</u> echnology(面実装技術)

SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (メールの送受に必要な処理手順)
SN	Standardizing Notice (標準化通知書)
S/N	Signal to Noise Ratio (信号対雑音比)
SoC	System on Chip (システムの機能全体を1チップに納めたLSI)
SOG	Sea of Gate (全面素子形成型ゲートアレイ)
SOG	Spin on Glass (シリカ系化合物による凹部の平坦化法)
SOHO	Small Office Home Office (小事務所や自宅を仕事場とする環境)
SOI	Silicon on Insulator (絶縁材料の上にシリコンを形成したウェーハ)
SOJ	<u>S</u> mall <u>O</u> utline <u>J</u> -leaded Package
SOP	Small Outline Package (表面実装型小型外圍器)
SOP	System on Panel (液晶ガラス上にメモリーなどのLSIを一体化したもの)
SOR	Synchrotron Orbital Radiation (シンクロトロン放射)
SOS	Silicon on Sapphire (サファイア基板上シリコン)
SOX	Sulfur Oxygen X (硫黄酸化物)
SP	Sales Price (売価)
SPC	Statistical Process Control (統計的プロセス管理)
SPC	Strategic Products Control (戦略的生産管理)
SPEC	<u>S</u> pecification (規格)
SPL	Sample (サンプル、見本)
SPM	Scanning Probe Microscope (走査型プローブ顕微鏡)
SPV	<u>S</u> urface <u>P</u> hoto <u>v</u> oltage (表面光電位法)
SQC	Statistical Quality Control (統計的品質管理)
SR	Seed Rotation (シード回転)
SR	Shift Register (シフトレジスター)
SR	Silicon Rectifier (シリコン整流素子)
SR	Spreading Resistance (広がり抵抗)
SR	Synchrotron Radiation (シンクロトロン放射)
SRAM	Static RAM (記憶保持操作がいない、読出し・書込み可能メモリ)
SRMI	Surface recombination velocity Related Microwave Intensity
SS	Society Specification
SS	System Software
SSA	Semiconductor Safety Association (半導体安全協会)
SSB	Single Side Band (片側抑圧搬送波)
SSI	Small Scale Integrated Circuit (小規模集積回路)
SSi	<u>S</u> uper <u>S</u> ilicon Crystal Research Institute Co. (スーパーシリコン研究所)
S <sup>2</sup> L	<u>S</u> elf Aligned <u>S</u> uper Injection <u>L</u> ogic
SSOR	Solid State Optical Relay (固体光リレー)
SSQA	Standard Supplier Quality Assessment (供給者品質監査標準)
SSR	Serial Shift Resister
SSR	Solid State Relay (固体リレー)

SSS	Silicon Symmetrical Switch
S <sup>3</sup> L	<u>S</u> chottky <u>S</u> elf Aligned <u>S</u> uper Injection <u>L</u> ogic
SST	<u>S</u> uper <u>S</u> elf-aligned Process <u>T</u> echnology
SST	Super Sonic Transport (超音速旅客機)
SSTM	Small Signal Transfer Mold Transistor
STA	Science & Technology Agency (科学技術庁)
STAMP	Soldering, Test Analyzer, Marking & Packing System
STB	Set Top Box (チューナーやアダプターのこと)
STD	Standard (標準 標準的な)
STEM	Scanning Transmission Electron Microscope
STEP	Strategic Technology & Engineering Promotion
STEP-90	Development of <u>S</u> oftware <u>T</u> echnology and <u>E</u> xcellent <u>P</u> roducts toward 19 <u>90</u> s
STI	Shallow Trench Isolation (浅いトレンチによる素子間分離)
STL	Schottky Transistor Logic
STM	Scanning Tunneling Microscope (走査型トンネル顕微鏡)
STN	Super Twisted Nematic (ねじれネマティック方式)
STTL	Schottky Transistor-Transistor Logic
SUPER	Solder Utilized Process with Eutectic Reaction
SUS	<u>S</u> pecial <u>U</u> se <u>S</u> tainless Steel (特殊用途ステンレス鋼材)
SVGA	Super Video Graphics Array (800×600ドットの表示規格)
SVS	<u>S</u> upervisory <u>S</u> ystem
SW	Switch (スイッチ)
SWR	Standing Wave Ratio (定在波比)
SXGA	Super Extended Graphics Array (1280×1024ドットの表示規格)

\* T

TA	Terminal Adapter (ISDN用端末装置)
TAB	Tape Automated Bonding (テープキャリア方式の一括自動ボンディング法)
TAPLAS	TOSHIBA Automatic Pattern Layout and Analysis System
TAT	Turn Around Time (開発・試作・評価などの時間)
TC	Thermo Compression (熱収縮)
TCM	Thermal Conduction Module (熱伝導モジュール)
TCP	Tape Carrier Package (テープ状のフィルムを使用したICパッケージ)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (業界標準水平分散プロトコル)
TCR	Time Counter Register
TCS	Trichrole Silicon (三塩化シリコン)
TCT	Temperature Cycle Test (熱衝撃サイクル試験)
TD	Technical Data (技術データ)
TDDDB	Time Dependent Dielectric Breakdown (酸化膜の経時絶縁破壊)
TDH	Time Dependent Haze (経時変化ヘイズ)
TEA CO <sub>2</sub>	Transversely Excited Atomic CO <sub>2</sub>
TED	TOSHIBA Engineering Data (東芝技術データ)
TEG	Test Element Group (プロセス評価用素子)
TEG	<u>T</u> ri <u>e</u> thyl <u>g</u> allium (トリエチルガリウム)
TEM	Transmission Electron Microscope (透過型電子顕微鏡)
TEOS	<u>T</u> etra <u>e</u> thyl <u>o</u> rtho <u>s</u> ilicate (テトラエチルオルソシリケート)
TES	TOSHIBA Engineering Standard (東芝技術標準)
TFIC	Thick Film Integrated Circuit (厚膜集積回路)
TFP	Task Force Project
TFT	Thermal Fatigue Test (熱疲労試験)
TFT	Thin Film Transistor (薄膜トランジスタ)
TGA	Thermogravimetric Analyzer
THB	Temperature, Humidity & Bias
THC	Total Hydrocarbon (全炭化水素)
TI	Technical Information (技術情報)
TI	Total Inspection
TIFF	Tagged Image File Format (画像処理用ファイル形式)
TIR	Total Indicating Reading (ウェーハ表面と基準平面との距離の最大・最小の差)
TLCS	TOSHIBA LSI Computer System
TMA	<u>T</u> hermo <u>m</u> echanical <u>A</u> nalyzer (熱機械分析器)
TMA	<u>T</u> ri <u>m</u> ethyl <u>a</u> luminum (トリメチルアルミニウム)
TMAH	Tetra Methyl Ammonium Hydroxide
TMD	Ttransfer Mold Die (熱硬化樹脂モールド型)
TMG	<u>T</u> ri <u>m</u> ethyl <u>g</u> allium (トリメチルガリウム)
TMP	<u>T</u> urbo <u>m</u> olecular <u>P</u> ump (ターボ分子ポンプ)

TO	Transistor Outline(トランジスタの外囲器)
TOC	Total Organic Carbon(全有機炭素)
TOEFL(トフル)	Testing of English as a Foreign Language(英語圏の大学に入学するための外国人への学力テスト)
TOEIC(トイック)	Test of English for International Communication(英語での国際的なコミュニケーション能力を測定するテスト)
TOPICS	Total On-line Production Information and Control System
TOPIX	<u>T</u> okyo <u>S</u> tock <u>P</u> rice <u>I</u> ndex(東証株価指数)
TOPRUN	<u>T</u> otal <u>P</u> ro <u>d</u> uctive System for <u>T</u> ransistor
TOPS	<u>T</u> est <u>P</u> rogram <u>O</u> ptimizing <u>S</u> oftware System
TOV	Turn Out Value
TOX	Thickness of Oxide(酸化膜厚さ)
TP	Test Piece(テストピース)
TP	Total Productivity(全体生産性)
TPH	Thermal Printing Head(感熱印刷素子)
TPL	<u>T</u> rans <u>p</u> ar <u>l</u> ucent
TPM	Total Productive Maintenance(総合生産保全)
TPO	Time, Place, Occasion(時、場所、場合)
TPSS	Techorandom Pipe Special S(高級炭化珪素チューブ)
TQC	Total Quality Control(総合的品質管理)
TQM	Total Quality Management(業務・経営全体の質向上管理)
TR	Transistor(トランジスタ)
TRIAC	<u>T</u> riode <u>A</u> C Semiconductor Switch(双方向サイリスタ)
TRON	<u>T</u> he <u>R</u> ealtime <u>O</u> perating System <u>N</u> ucleus(PC用日本版OS)
TRXRF	<u>T</u> otal <u>R</u> eflection <u>X</u> - <u>R</u> ay <u>F</u> luorescence spectroscopy(全反射蛍光X線分光)
TS	Test Sample(試験用見本)
TS	Thermo Sonic(熱超音波法)
TSG	TOSHIBA Semiconductor Germany(東芝西ドイツ社)
TSIA	Taiwan Semiconductor Industry Association(台湾半導体産業協会)
TSOP	Thin Small Outline Package(表面実装用薄型パッケージ)
TSS	Temperature Step Stress
TSS	Time Sharing System(時分割多重実行システム)
TST	Thermal Shock Test(熱衝撃試験)
TSTSS	Thermal Shock Test & Step Stress
TT	Technology Transfer(技術移転)
TTL	Through the Lens(レンズ透過光による露出条件測定方式)
TTL	Transistor-Transistor Logic(トランジスタ・トランジスタ論理回路)
TTV	Total Thickness Variation(ウェーハ全面の厚さバラツキ)
TV	Television(テレビジョン)

TV	Test Voltage (試験電圧)
TV	Toggle Valve
TWAIN	Technology Without Any Interested Name (パソコンに画像を取り込むための標準規格)
TXRF	Total reflection X-Ray Fluorescence spectroscopy (全反射蛍光X線分光)
TZDB	Time Zero Dielectric Breakdown

\* U

UBM	Under Bump Metal (バンブ下バリアメタル)
UCL	Upper Control Limit (上方管理限界)
UCS	Ultra Clean Society (超清浄度協会)
UCT	Ultra Clean Technology (超清浄化技術)
UDO	Undoped Oxide (非ドーパ酸化膜)
UF	Ultra Filtration (限外ろ過)
UFO	Unidentified Flying Object (未確認飛行物体)
UHF	Ultra-High Frequency (極超短波)
UJT	Uni-Junction Transistor
UL	Underwriters Laboratories Inc. (米国材料・装置の検査機関)
ULPA	Ultra Low Penetration Air
UNESCO	United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization (国連教育科学文化機関)
UPS	Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
UPS	Uninterruptible Power Supply (無停電電源装置)
URL	Uniform Resource Locator (インターネット上のファイルの住所)
US	<u>U</u> ltrasonic (超音波)
USB	Universal Serial Bus (PCと周辺機器を接続するためのインターフェース)
USM	Ultra Super Mini Package
USP	United States Patent (米国特許)
UV	<u>U</u> ltraviolet Rays (紫外線)

\* V

VA	Value Analysis (価値分析)
VA	Value Assurance
VAD	Vapor phase Axial Deposition
VAN	Value Added Network (付加価値通信網)
VAT	Value Added Tax (付加価値税)
V-ATE	V-Shaped Air Isolation Technology
VC	Value Control (価値管理)
VCD	Variable Capacitance Diode (可変容量ダイオード)
VCM	Voice Coil Motor (ボイスコイルモータ)
VCM	Voltage Controlled Multivibrator
VCO	Voltage Controlled Oscillator (電圧制御発振回路)
VCR	Video Cassette Recorder (VTRの海外での呼称)
VDP	Video Disk Player
VDT	Video Display Terminal (ディスプレイ端末)
VE	Value Engineering (価値工学)
VFD	Vacuum Fluorescent Display (真空蛍光表示管)
VG	Vapor Growth (気相成長)
VGA	Video Graphics Array (640×480ドットの表示規格)
VHF	Very High Frequency (超短波)
VHS	Video Home System (家庭用ビデオシステム)
VHSIC	Very High Speed IC (超高速集積回路)
VI	Value Improvement (価値改善)
VICS	Vehicle Information and Communication System (道路交通情報通信システム)
VIL	Vertical Injection Logic (縦方向注入口ジック)
VISION	Value Innovation, Strategic office, Intelligent office, Office Network
VIST	Vertically Isolated Self-aligned Transistor
VLSI	Very Large Scale Integration (超大規模集積)
VOC	Volatile Organic Compound (揮発性有機化合物)
VPD	Vapor Phase Decomposition Method (気相中分解法)
VPE	Vapor Phase Epitaxy (気相エピタキシャル成長)
VPS	Vapor Phase Soldering (気相はんだ法)
VR	Value Research (価値研究)
VR	Virtual Reality (仮想現実感)
VRAM	Video RAM (画面出力用メモリ)
VSOP	Very Small Outline Package
VTR	Video Tape Recorder (ビデオデッキ)
VVVF	Variable Voltage Variable Frequency (可変電圧可変周波数装置)

\* W

WA	Work Assignment (ワークアサインメント、業務割付)
WAT	Wafer Approval Test (ウェーハ認定試験)
WAT	Wafer Authorized Test
WB	Wire Bonder (ワイヤボンダ)
WB	Wire Bonding (ワイヤボンディング)
WDIP	Dual Inline Package with Window (窓付きDIP)
WDM	Wavelength Division Multiplexing (波長分割多重方式)
WDMA	Wavelength Division Multiplex Access (波長分割多重接続)
WF	Work Factor (ワークファクタ)
WG	Working Group (作業部会)
WHO	World Health Organization (世界保健機関)
WIS	Wafer Inspection System (ウェーハ表面検査システム)
WJ	Work Job
WLBI	Wafer Level Burn-In (ウェーハでのバーンインテスト)
WLP	Wafer Level Packaging (ウェーハでの外囲器研成)
WOM	Write Only Memory (書き込み専用メモリ)
WP	Word Processer (ワードプロセッサ、ワープロ)
WPH	Wafers per Hour (1時間当たりのウェーハ処理数)
WS	Work Sampling (ワークサンプリング)
WS	Work Station (ワークステーション)
WSA	Wafer Surface Analysis (ウェーハ表面不純物分析)
WSC	World Semiconductor Council (世界半導体会議)
WSI	Wafer Scale Integration (ウェーハ規模集積化)
WSTS	World Semiconductor Trade Statistics (世界半導体市場統計)
WTO	World Trade Organization (世界貿易機構)
WWW	World Wide Web (インターネット広域情報システム)
WYSIWYG	What You See is What You Get (画面で見た通りの印刷ができること)

\* X

XGA	Extended Graphics Array (1024×768ドットの表示規格)
XMA	X-Ray Micro Analyzer (X線マイクロ分析装置)
XPS	X-Ray Photoelectron Spectroscopy (X線励起光電子分光)
XRT	X-Ray Topograph (X線トポグラフ)

\* Y

YAG	Yttrium Aluminium Garnet (レーザー発振用材料)
-----	--------------------------------------

\* Z

ZD	Zero Defective Movement (無欠点運動)
ZEV	Zero Emission Vehicle (無公害車)
ZIP	Zigzag Inline Package
ZIP	Zone Improvement Program (米国郵便番号)